

設備使用料

令和3年2月1日～

別表

部門	機械及び器具	単位	金額
繊維	染色装置	30分	820
	繊維引張試験機	30分	540
	染色堅ろう度試験機	30分	520
	熱画像解析装置	1時間	470
	燃数測定器	30分	290
	繊維測定器	30分	260
	繊維実体顕微鏡	30分	370
木工	一般木工工作機械(のこ盤、かんな盤、角のみ盤、面取り機、木工旋盤、ベルトサンダー、コーナーロックング、ほぞ取り盤、ルーターマシン等)	30分	230
	一般木工プレス機械(組立プレス、フラッシュプレス等)	30分	40
	NC木工機械(NCルーター、NCラジアルソー)	30分	1,320
	低温恒温恒湿機	1時間	2,040
窯業建材	微粉碎機	1時間	430
	粗粉碎機	30分	2,100
	土練機	30分	540
	粒度分布測定装置	1時間	1,730
	ゼータ電位・粒度分布測定装置	30分	2,250
	パン型造粒機	1時間	670
	熱定数測定装置	1時間	3,000
	加圧成形機	1時間	820
	陶芸用焼成炉	1時間	1,280
電磁両立性計測(EMC)	電磁波半無響システム(電波暗室)	1時間	6,130
	電磁波遮蔽システム(シールドルーム)	1時間	1,130
	放射エミッション試験装置	1時間	4,090
	伝導エミッション試験装置	1時間	3,660
	放射イミュニティ試験装置(IoTセ)	1時間	3,150
	伝導イミュニティ試験装置	1時間	2,080
	バルクカレントインジェクション試験装置	1時間	1,830
	静電気試験装置(IoTセ)	1時間	1,570
	電氣的ファストランジエントバースト試験装置(IoTセ)	1時間	2,310
	雷サージ試験装置(IoTセ)	1時間	2,430
	電源周波数磁界試験装置	1時間	1,420
	電圧ディップ・瞬停試験装置	1時間	1,440
	高調波フリッカ試験装置	1時間	1,490
	安全規格試験装置	1時間	860
	残留電荷試験装置	1時間	940
	機械電子	落下衝撃試験装置	30分
小型環境試験機		1時間	670
振動試験装置		1時間	2,410
冷熱衝撃試験装置		1時間	900
加速寿命試験装置		1時間	660
電気計測機器		30分	510
静電気試験機(置賜)		30分	540
インパルスノイズ試験機(置賜)		30分	540
瞬断瞬停試験機(置賜)		30分	540
ファーストランジエントノイズ試験機(置賜)		30分	500
雷サージ試験機(置賜)		30分	730
放射イミュニティ測定システム(置賜)		30分	1,290
耐水試験機		1時間	1,000
産業用ロボット		1時間	1,000
単腕型協働ロボット		1時間	1,590
双腕型協働ロボット		1時間	1,890
生産シミュレーションシステム		1時間	2,150
汎用シミュレーションシステム		1時間	1,390

部門	機械及び器具	単位	金額
工業材料	原子間力顕微鏡(AFM)	30分	3,910
	材料試験機	30分	1,480
	材料試験機(高温用大気炉及び恒温槽を使用する場合)	30分	2,120
	微小材料試験機	30分	2,200
	分析走査電子顕微鏡	1時間	2,460
	電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	1時間	6,610
	電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)	1時間	8,820
	光電子分光分析装置(XPS)	1時間	12,100
	グロー放電発光分光分析装置(GD-OES)	1時間	5,830
	硬さ試験機	30分	530
	微小硬度計	30分	360
	摩擦摩耗試験機	30分	1,140
	エックス線テレビシステム(庄内)	30分	1,390
	マイクロフォーカスエックス線検査装置(置賜)	30分	940
	エックス線CT検査装置(庄内)	1時間	2,810
	サブミクロンフォーカスエックス線検査装置(置賜)	30分	2,310
	マイクロフォーカスエックス線CTシステム(IoTセ)	1時間	7,410
	デジタルスコープ	30分	350
	熱膨張計	1時間	720
	機械加工	超精密加工機	30分
ATC付NC立型ミーリングマシン(マシニングセンタ)		30分	2,870
5軸加工機		30分	4,310
NC金型磨き装置		30分	2,200
NC創成放電加工機		30分	2,700
ワイヤーカット放電加工機		30分	2,010
NC彫削放電加工機		30分	2,430
細穴放電加工機		30分	1,450
環境型微細プレス加工装置(ナノインプリント)		30分	3,480
光学設計システム		30分	770
機械計測	三次元測定機(山形、庄内)	30分	1,250
	超高精度三次元測定機(IoTセ)	30分	3,140
	表面粗さ輪郭形状測定機	30分	1,770
	レーザー干渉計システム	30分	1,480
	真円度測定機	30分	1,290
	画像測定機	30分	1,720
	三次元表面構造解析顕微鏡	30分	3,070
	万能測長機	30分	810
	万能測定顕微鏡	30分	590
	振動解析システム	30分	1,000
高分子材料加工	射出成形機	30分	880
	アイゾット衝撃試験機	1時間	330
	混練押出機	1時間	2,350
	荷重たわみ温度試験機	1時間	990
	熱プレス	1時間	660
	メルトフローテスター	1時間	440
	粘度計	30分	520
	樹脂流動解析システム	30分	2,280
	サポート材除去装置	1時間	730
	食品	生物顕微鏡システム	30分
凍結乾燥機		1時間	640
レトルト高圧蒸気滅菌器		1時間	350
恒温器		24時間	360
ファーマンター		1時間	470
微生物分類同定分析装置		30分	7,310
洗米機		30分	50
遠心分離機		30分	590
全自動糖分析装置		30分	3,580
醸造成分分析装置		30分	410
低温インキュベーター		24時間	1,330
食品用圧縮試験装置		30分	580

部門	機械及び器具	単位	金額
金属材料	画像解析装置	30分	450
	試料埋込機	30分	180
	光学顕微鏡	30分	370
	試料切断機	30分	590
	大気焼成炉	1時間	2,550
	雰囲気可変焼成炉	1時間	2,160
	通電焼結装置	1時間	5,120
	金属溶解炉	1時間	3,730
	凝固解析装置	1時間	970
	自動研磨装置	30分	760
分析	蛍光エックス線分析装置	1時間	2,690
	ICP発光分光分析装置	30分	1,630
	炭素・硫黄分析装置	30分	1,780
	ピーエッチ・メータ	30分	750
	マイクロウェーブ分解装置	1時間	4,070
	原子吸光分析装置	30分	540
	可視紫外分光光度計	30分	390
	顕微赤外分光分析装置(置賜、庄内)	30分	960
	赤外分光分析装置(IoTセ)	30分	1,990
マイクロ マシンング	ア트워크作成装置	1時間	1,600
	スピコーター	30分	590
	両面マスクアライナ	1時間	2,860
	スパッタリング装置	1時間	3,070
	スパッタリング装置 (金又は白金族金属の膜を形成しようとする場合)	1時間	6,470
	真空蒸着装置	1時間	2,970
	酸化拡散炉	1時間	2,750
	プラズマエッチング装置	30分	790
	ダイシングソー	30分	2,310
	ワイヤボンダ	30分	880
	ホール効果測定装置	30分	560
	光学式膜厚計	30分	630
	レーザー加工装置	1時間	1,410
	陽極接合装置	1時間	360
	レーザー描画装置	1時間	5,280
	触針式段差測定装置	30分	1,000
	ウェットエッチング装置	30分	460
	反応性イオンエッチング装置(RIE)	1時間	8,810
	インクジェット塗布装置	1時間	3,640

(注)使用の単位がこの表の単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。